

## 著者略歴

**堀越 佳治** (ほりこし よしじ)

東北大学工学部電気工学科卒，同大学院工学研究科電子工学専攻修士課程，博士課程修了。工学博士。

NTT 基礎研究所研究員，ドイツ・マックスプランク固体研究所研究員，北海道大学客員教授，東北大学客員教授を経て，早稲田大学理工学部教授。早稲田大学名誉教授。

主な著書

“GaInAsP Alloy Semiconductors” Ed. T. P. Pearsall, Chap. IV-15, 1981, Wiley.

“Semiconductors and Semimetals” Vol. 22, PartC, Vol. Ed. W. T. Tsang, Chap. 3, 1984, Academic Press.

“Molecular Beam Epitaxy” Ed. H. Asahi and Y. Horikoshi, Chap. 2 and 3, 2019, Wiley.

“太陽光発電-基礎から電力系への導入まで-” 物質・材料テキストシリーズ，堀越佳治，2020，内田老鶴園。

**河原塚 篤** (かわはらづか あつし)

早稲田大学理工学部電気・情報生命工学科卒，同大学院工学研究科修士課程，博士課程修了。博士(工学)。

ドイツ・ポール・ドゥルレーテ固体研究所博士研究員，早稲田大学高等研究所講師，准教授，早稲田大学各務記念材料技術研究所主任研究員。

2023年12月25日 第1版発行

検印省略

著者 堀越佳治

河原塚篤

発行者 内田学

印刷者 山岡影光

化合物半導体のエピタキシャル成長  
多様な成長技術とその応用

発行所 株式会社 内田老鶴園 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K. K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 678-1

ISBN 978-4-7536-5051-4 C3042

©2023 堀越佳治，河原塚篤